

# 光學偵測系統及其干涉控制方法

## 本院覽號

02A-1010911

## 公告日期

## 智財權狀態

台灣(發明)I540308放棄維護

## 摘要

本發明可成功將像散式量測系統的干涉現象消除，可以大幅提升像散射光學儀器的性能。也利用此技術，能刻意製造穩定波長的人工干涉，進一步利用此人工干涉校正致動器之位移。

## 技術優勢

像散式量測技術已用在許多精密量測上，因其具有非常高的訊號頻寬與次奈米級的解析度，此發明可以消除在精密量測上遇到之干涉問題，進一步提升相關儀器的性能。本發明亦可改變實施的方式，產生干涉，用此干涉進行致動器行程的校正。

## 應用範圍

需使用到像散式量測系統的光學儀器，例如：像散式原子力顯微鏡、MEMS微結構量測平台等。

## 創作人

胡恩德、黃英碩、王偉珉、鄭仲翔



中央研究院  
ACADEMIA SINICA